

※課題番号 : F-12-KT-0138  
※支援課題名 (日本語) : 微細回折格子の作製  
※Program Title (in English) : Fabrication of micro diffraction grating  
※利用者名 (日本語) : 藤原 哲嗣  
※Username (in English) : Noritsugu Fujiwara  
※所属名 (日本語) : 独立行政法人造幣局 研究開発課  
※Affiliation (in English) : Japan Mint

※概要 (Summary) :

**【相談】**

電子線・光リソグラフィ及びドライエッチング技術を用いた金属上への微細溝加工を行いたい。

**【回答】**

ナノハブ拠点では、高速高精度電子ビーム描画装置を始めとする各種描画装置、電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置等のドライエッチング装置を共用しており、要望の加工に対応できる。

**【結果】**

平成 25 年度より、ナノテクノロジープラットフォームテーマとしてナノハブを利用する。

※実験 (Experimental) :

技術相談段階のため割愛

※結果と考察 (Results and Discussion) :

技術相談段階のため割愛

※その他・特記事項 (Others) :

なし